

△×				APPROVED	CHECKED	<u>MATERIAL</u> 材料				—		<u>CHAMFER</u> 一般面取		—		<u>QUANTITY</u> 個数	
△×				T. A.	T. A.	<u>TREATMENT</u> 処理				—		<u>FINISHING</u> 仕上		—			
△×						<u>TREATMENT CONTACT</u> 処理接点				—		<u>DECENTRATION</u> 偏芯		—			
△×						OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	<u>METHOD</u> 図法	<u>REMARK</u> 適用（機種名）			
△× 2	ホルト 範囲追加	20.10.07	R. H.	DESIGNED	DRAWN	OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15		—		V S - T H V 1 - 1 5 0 C 0 / S			
△× 2	rotation・Iris ring表記追加	19.03.03	T. F.	T. A.	H. M.	OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1		SCALE	1 / 1	NAME	D R A W I N G / 外 観 図		
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1	DATE	17.11.08	DRAW NO.	0 D T C 0 5 8 2 A 3			
						<u>TOLERANCES</u>				A	B	C	⑤				